

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 2 区分

【発行日】平成20年5月22日 (2008.5.22)

【公開番号】特開2002-66751(P2002-66751A)

【公開日】平成14年3月5日 (2002.3.5)

【出願番号】特願2001-110713(P2001-110713)

【国際特許分類】

B 2 3 K 15/00 (2006.01)

B 2 3 K 103/08 (2006.01)

【F I】

B 2 3 K 15/00 5 0 6

B 2 3 K 15/00 5 0 1 B

B 2 3 K 103:08

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月7日 (2008.4.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 エーロfoil構造体の製造のため超合金材料（12）間の接合部（10）を電子ビーム溶接する方法であって、当該方法が、超合金材料からなる溶接可能なシム（14）を接合部に挿入し、これら超合金材料を電子ビームで加熱する工程を含んでおり、上記シムが 0.040 インチ（1.016 mm）～ 0.100 インチ（2.54 mm）の厚さを有していて、上記加熱工程が、100～130 kV の電圧及び 25～35 mA の電流で 20～30 インチ/分（50.8～76.2 cm/分）の速度で電子ビームを加速することを含む、方法。

【請求項 2】 前記シム（14）が鍛造、鋳造又は粉末冶金法で形成される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 前記加熱工程が、電子ビームを高電圧又は低電圧電子ビーム溶接機で加速することを含み、その際の電圧が接合部（10）の完全な溶込みに十分な高さで、電流がベース金属及びシム（14）の完全な溶融を達成するものである、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】 前記加熱工程を単一パスで完了する、請求項 1 に記載の方法。